

2024年4月吉日

お客様各位

アルテック株式会社
第2産業機械事業部
AS営業部

「The 15th Annual MEMS Engineer Forum 2024」出展のご案内

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は、来たる2024年4月17日(水)～18日(木)の2日間、東京・両国のKFCホールにて開催されます、MEMSパークコンソーシアム主催の世界最大のナノテクノロジー技術の祭典であります「The 15th annual MEMS Engineer Forum (MEF) 2024」に出展いたします。本展示会では、弊社パートナーである下記の欧米メーカー各製品を展示いたします。

- ・ Hummink 社(フランス)
世界最細線直描装置(※新製品)
- ・ Fastmicro 社(オランダ)
パーティクル検査装置 (※動画展示)
- ・ Obducat Technologies 社(スウェーデン)
ナノインプリント関連装置(※パネルのみ)

御多忙中とは存じますが、是非この機会に弊社ブースにお越しいただき御高覧賜りたくお願い申し上げます。

敬具

開催概要	
展示会名	The 15 th Annual MEMS Engineer Forum (MEF) 2024
会期	2024年4月17日(水)～4月18日(木)
開催時間	4/17(水) 9:00～18:15, 4/18(木) 8:45～18:00
会場	KFC ホール(〒130-0015 東京都墨田区横網 1-6-1)
展示小間番号	Annex Hall R-34

【展示一覧と概要】

展示品・内容	特長
Hummink 社製 世界最細線直描画装置	
<p>卓上型 R&D 装置 NAZCA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 600nm-50μm のパターンニング ● 最大 10mm/sec の描画速度 ● 多様な材料(高粘度)にも適応可能。 ● (Au, Ag, Cu, Graphen, polymer, etc.) ● 多様な基板に対応可能 ● (Si, SiO2, Si3N4, Glass, Flexible, etc.) ● 多様なパターンの描画に対応可能 ● (Line, Circle, Grating, Dots, 3D pillar, etc.)
Fastmicro 社製パーティクル検査装置(動画展示)	
<p>マニュアル型光学式パーティクル検査装置 Sample Scanner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 非平滑面の付着物や、真空環境内のモニター等、これまで測定困難だった条件下での検査が可能 ● 最小 500nm サイズのパーティクル測定に対応 ● PMC カードを用いて、任意の対象表面からパーティクルを採取 ● Particle Fallout Scanner は真空チャンバー内に設置可能。落下パーティクルの経時モニタリング用に最適
Obducat Technologies 社製 ナノインプリント関連装置 (パネルのみ)	
<p>Eitre シリーズ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● スウェーデン Obducat Technologies AB 社は、マイクロ・ナノリソグラフィソリューションの革新的な開発者として、世界をリードするナノインプリント装置のサプライヤーです。ナノインプリントリソグラフィ、レジストおよびウェット処理、ファウンドリーサービスに注力、優れた COO パフォーマンスは業界で注目され、ユーザーに高く評価されています。

【お問い合わせ先】

アルテック株式会社 (〒104-0042 東京都中央区入船 2-1-1 住友入船ビル 2 階)

第 2 産業機械事業部 AS 営業部

担当： 松浦 (matsuura@altech.co.jp) または (ml-sentan@altech.co.jp)

TEL： 03-5542-6754 / FAX： 03-5542-6766

URL： <http://www.altech.co.jp/>